## ■10 群(集積回路)- 8 編(集積化センサとマイクロマシン)

# 8章 移相器とアンテナ

### 【本章の構成】

- 本章では以下について解説する.
  - 8-1 はじめに
  - 8-2 移相器
  - 8-3 アンテナ
  - 8-4 まとめ
  - 補遺 8-A 無損失 Loaded-line 移相器
  - 8 章演習問題

### ■10 群-8 編-8章

## 8-1 はじめに

(執筆者:鈴木健一郎) [2018年10月受領]

無線通信において搬送するデータ量が大きくなるに従って、信号を広帯域に分散させたり、 高い周波数を持つ搬送波で伝送したりすることが必要になる.このため、今日、無線システム の高周波化、広帯域化が強く要求されている.一方、電磁波は周波数が増大するに従って空気 中での減衰が増大するという性質があるため、60 GHz のミリ波帯を利用する無線システムで は指向性を持つ電磁波ビームを使用して遠方まで電磁波を搬送することになる.しかし、移動 無線システムにこのミリ波帯電磁波を応用するにはこの指向性ビームを走査することが必要 である.

近年,車の衝突防止のためにミリ波レーダの使用が注目されているが,現在のミリ波レーダ は機械式走査を利用してビーム走査するために走査速度が遅く,このため,広い角度にわたっ て電磁波を送受できないという課題がある(車のミリ波レーダでは,1走査に1ミリ秒程度の 高速走査が要求される.時速100 kmの車は1ミリ秒で2.8 cm移動する).これに対して,図 1・1 に示す波の干渉を利用した電子式ビーム走査を行うフェイズドアレイアンテナ(PAA)方 式は,電子スイッチの切り替え速度が速いために高速走査が可能であるという特徴を持ってい る.しかし,多数の電子部品が必要なため構造が複雑でコストが高いという問題があるために, 一部の特殊な分野に限定して利用されている.



図1・1 フェイズドアレイアンテナ (PAA) 方式の模式図

図1・2 は PAA の構成を模式的に示したものである. PAA は、多数のアンテナ、各々のアン テナに接続する電磁波の位相を制御する移相器、更に送信のためのパワー増幅器(受信のため の低ノイズ増幅委)から構成されている.半導体デバイスを利用した移相器(図1・2(a))では、 半導体デバイスの大きな損失と歪みの特性を補償するために、移相器とアンテナの接続点のそ れぞれに増幅機能を持つ補償回路を設けることが必要である.一方、MEMS スイッチを利用し た移相器(図1・2(b))の場合には、MEMS スイッチの優れた特性のために移相器とアンテナの それぞれ接続点に補償回路を設ける必要がないために、送受信回路要素を著しく減らすことが でき、この結果、小型化と低コストの PAA システムが実現できると期待される.



<sup>(</sup>a) 半導体デバイスを使用した移相器

(b) MEMS スイッチを使用

図1・2 PAAの構成

本節では、MEMS スイッチを搭載した移相器と近未来技術としての期待が大きい PAA の研究例を紹介する.

### ■10 群-8 編-8章

## 8-2 移相器

(執筆者:鈴木健一郎) [2018年10月受領]

位相を制御する移相器について過去に多くの研究がなされてきた. MEMS 移相器の基本構成 は、これら過去の移相器の研究成果を直接に利用したものが大半で、本節ではスイッチドライ ンとローディドラインの 2 つの移相器について述べる. なお、多数の MEMS スイッチを導波 路に並べた分布型 MEMS 移相器は MEMS 技術の特徴をうまく利用したものであり、文献 1) に詳述されている.

### 8-2-1 設計原理

移相器は,入力信号を参照信号と遅延信号の2つの高周波信号に変換することによって,両 者の位相差を生成する.2つの出力信号を切り替える際にスイッチを使用するが,スイッチ挿 入の際の伝送線路の長さの影響を抑制するために, λ/4スタブ回路がしばしば用いられる.

(1) 伝搬波長

高周波回路では基板の比誘電率の影響により、伝送線路を流れる信号の波長が真空中の波長 **λ**<sub>0</sub>よりも短くなるという波長短縮が起こる.基板上に作製された伝送線路を伝搬する波長は

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\rm eff}}} \tag{2.1}$$

で与えられる<sup>2)</sup>. ここで, ε<sub>eff</sub>は実効比誘電率であり,伝送方式により異なる値を持つ. 比誘電 率ε<sub>r</sub>を持つ基板の上に形成されたマイクロストリップ回路及び CPW の場合には,実効比誘電 率は

$$\varepsilon_{eff} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2}$$

である.このように、伝搬波長が基板の比誘電率に従って短くなることから、大きな比誘電率 を持つ基板の上に形成された伝送線路を流れる信号波長は大きく短縮されることとなる.この 結果、大きな比誘電率を持つ基板を使用すると高周波回路を小さく設計することが可能になる.

MEMS アンテナで利用されるいくつかの基板の代表的なパラメータを表 2・1 に示す. 誘電正接は誘電体損失の大きさを示すパラメータであり、この値が小さいほど損失が小さいことを表している. また,誘電正接は一般に周波数に依存して増大する.

比誘電率 & 誘電正接 tan δ 電気抵抗率[Ω·cm] FR-4 4.3 0.025  $1 \times 10^{15}$ Pyrex Glass (#7740) 4.6 0.005 以下 1×10<sup>8</sup>以上 高抵抗 Si 0.005 以下 1×10<sup>3</sup>以上 11.9 GaAs 12.8 0.005 以下 1×10<sup>7</sup>以上

表2・1 各種基板材料の電気的性質(< 30 GHz)

表 2・1 の比誘電率と式(2・1)及び式(2・2)を用いると,高抵抗シリコン基板の上に形成された 24 GHz 高周波回路の伝搬波長として約 4.92 mm が得られる.これは真空中の伝搬波長 12.5 mm

 $(2 \cdot 2)$ 

に対して 1/2.54 の波長短縮が生じたことを意味する. なお, FR-4 基板の上に形成された高周 波回路の伝搬波長は約 7.68 mm である.

### (2) λ/4 スタブ伝送線路

本節では,図2・1に示すように,分岐した伝送線路の先端をグランド(GND)に短絡させた 回路を検討する.



図2・1 長さlの短絡スタブ回路

図 2・1 に示す長さ1の伝送線路は6章6-6節で検討した短絡スタブ回路である.このスタブ 線路の規格化入力インピーダンスは、先に示したように、

$$z(l) = j \tan \beta l = j \tan 2\pi \left(\frac{l}{\lambda_{\alpha}}\right)$$

(6 · 1)

と与えられる.ここで、 $\lambda_g$  は式(2·1)で与えられる伝搬波長を示している.この入力インピー ダンスは線路長 lの関数であり、 $l/\lambda_g$ が 1/4 となる位置では入力インピーダンスが無限大とな る.これは伝送線路に  $\lambda_g/4$ 線路の分岐がない状態と等しいことを意味している.すなわち、 スタブ長 l が  $\lambda_g/4$ のときには、ポート1及び2にスタブの影響は及ぶことがない.この性質 を利用した移相器を以下に示す.

### (3) スイッチドライン移相器

図 2・2 は Switched-line 移相器の原理を模式的に示したものである. この移相器は出力信号の 位相を変化させるために 3 個の(並列接続型) MEMS スイッチを使用しており,入力及び出力 ポートからλ/4の位置に設けられている.入力及び出力ポートのそれぞれは 2 つに分岐してお り,上側の伝送線路(遅延線路)は下側のもの(参照線路)に比べて電気長(2π(線路長/λ<sub>g</sub>)) がΔφだけ長く設計されている. すなわち,線路長差が1のときの位相差は

$$\Delta \phi = 2\pi \frac{l}{\lambda_g} = 2\pi \frac{l}{c_g} f \tag{2.3}$$

である.ここで、 $\lambda_g, c_g$ はそれぞれ導波路を伝搬する波長(式(2·1))と速度である.また、周 波数をfとした.この遅延線路を伝搬する信号は参照線路を伝搬する場合に比べて位相が $\Delta \phi$ だ け遅れる.式(2·3)に示すように、スイッチドライン移相器の移相量 $\Delta \phi$ は周波数に比例して増 大する.

遅延及び参照線路への切り替えは3個の MEMS スイッチを使用して以下のようになされる.

- i) 遅延線路の2つのスイッチを閉じる(参照線路のスイッチは開く)と、入力ポートの信号は下側の参照線路を通って出力ポートに搬出される.
- ii) 一方、参照線路のスイッチを閉じる(遅延線路の2つのスイッチは開く)と、入力ポートの信号は上側の遅延線路を通って出力ポートに搬出される.



図2・2 Switched-line 移相器の模式図

ここで,スイッチが閉じたときに形成される $\lambda_g/4$ スタブ回路の入力インピーダンスが入出力ポートのそれぞれに対して無限大(すなわち開放)になることが重要である.このため,遅延及び参照線路のそれぞれを互いに独立して動作させることが可能になる.

図2・3 はスイッチドライン移相器を利用した3ビット移相器の構成を模式的に示したもので ある.それぞれの移相器で45,90,180°の移相を行うことによって,0~315°までの範囲で45° 刻みの移相を実現することができる.スイッチドライン移相器は原理が直截的であり,任意の 移相角を実現することができる反面,デバイス寸法が大きいという欠点がある.このため,大 きな移相角を実現するのに利用される.



図2・3 スイッチドライン移相器を利用した3ビット移相器の模式図

### (4) ローディドライン移相器

図 2・4 は無損失 Loaded-line 移相器の構成を示したものであり、2 種類の負荷(サセプタンス B<sub>1</sub> 及び B<sub>2</sub>)が特性インピーダンス Z<sub>c</sub>を持つ電気長 $\theta$ の伝送線路の両側に並列に挿入された構造を持つ<sup>3</sup>. 4 個のパラメータ B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, Z<sub>c</sub>,  $\theta$ は多数の組合せが存在する. いま, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>によって移相器の位相がそれぞれ( $-\pi/2 - \Delta\phi/2$ )と( $-\pi/2 + \Delta\phi/2$ )だけ遅れるとすると以下の関係式が成立する(補遺 8-A 参照).

$$B_1 = Y_0 \left[ \frac{\cos \theta}{\cos(\Delta \phi/2)} + \tan(\Delta \phi/2) \right]$$
(2 • 4a)

 $(2 \cdot 4c)$ 

$$B_{2} = Y_{0} \left[ \frac{\cos \theta}{\cos(\Delta \phi/2)} - \tan(\Delta \phi/2) \right]$$

$$Z_{c} = Z_{0} \frac{\cos(\Delta \phi/2)}{\sin \theta}$$

$$(2 \cdot 4c)$$

$$(2 \cdot 4c)$$

ここで、Z<sub>4</sub>と Y<sub>6</sub>はそれぞれ入出力ポートの特性インピーダンスと特性アドミタンスである.2 種類のサセプタンス B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>の切り替えは連動して動作する2個のスイッチによって行われる.



図2・4 無損失 Loaded-line 移相器の模式図



図2・5 サセプタンスB1, B2による移相器の位相遅れを示す位相ベクトル図

図 2・5 はサセプタンス  $B_1$ ,  $B_2$ によって移相器の位相遅れが  $-\pi/2 - \Delta \phi/2$  から $-\pi/2 + \Delta \phi/2$  まで △φだけ変化する様子を位相ベクトル図によって示したものである. この図から分かるように Loaded-line 移相器では180度以上の大きな移相を実現することは不可能である.また,Switchedline 移相器に比較して移相器の寸法を小型にすることができる(すなわち低損失になる)とい う特徴がある.

次に、この Loaded-line 移相器を並列 MEMS スイッチを利用して実現することを考える.  $\theta = \pi/2$ に設定すると、サセプタンス  $B_1, B_2$ は式(2·2)より以下のように簡略化される.

$$B_{1,2} = \pm Y_0 \tan(\Delta \phi/2)$$

 $(2 \cdot 5)$ 

このとき  $B_1 = -B_2$ となり, (損失が小さい場合には) 2 つのアドミタンスは複素共役量となる. 一方, 無損失の短絡伝送線路(Short-stub)の入力インピーダンスは6章 6-6節式(6・1)で与 えられ、このアドミタンスは以下のようになる.

$$Y(l) = -jY_{ss}\cot 2\pi \left(\frac{l}{\lambda}\right) = -jY_{ss}\cot\theta$$
(2.6)

ここで、 $Y_{ss}$ は Short-stub の特性アドミタンスであり、通常、特性インピーダンス  $1/Y_{ss}$ を 60~80  $\Omega$ と少し高めに設計する.式(2・4)から、電気長 $\theta_1$ + $\theta_2$ を持つ Short-stub のサセプタンス  $B_1$ と電気長 $\theta_1$ を持つ Short-stub の  $B_2$ が

$$B_1 = -Y_{ss} \cot(\theta_1 + \theta_2) = Y_{ss} \tan\left(\theta_1 + \theta_2 - \frac{\pi}{2}\right)$$
(2 · 7a)

$$B_2 = -Y_{ss}\cot(\theta_1) = -Y_{ss}\tan\left(-\theta_1 + \frac{\pi}{2}\right)$$
(2 · 7b)

と与えられる.  $Y_{ss}$ の値が  $Y_0$ に近いと考えると,式(2·5)と式(2·6)より以下の近似関係が得られる.

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2} + \frac{\Delta\phi}{2}$$

$$\theta_1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}$$
(2 · 8)

すなわち,2つのサセプタンス $B_1$ 及び $B_2$ の電気長はそれぞれ $\pi/2$ より $\Delta\phi/2$ だけ長いものと短いものとなる.

図 2・6 は並列接続スイッチを利用して Short-stub の長さを変化させた Loaded-line 移相器の構成を示したものである. △φの移相は, 2 個の MEMS スイッチを以下のように使用して Short-stub の長さを切り替えることによって実現される.



図2・6 並列接続スイッチを利用した Loaded-line 移相器

- i) 2 つのスイッチを開くと、Short-stub の電気長は $\theta_1 + \theta_2$  (サセプタンス  $B_1$ ) となり、図 2・ 5 に示すように、入力信号と  $-\pi/2 \Box \Delta \phi/2$  だけ位相が遅れた信号が出力ポートに搬出さ れる.
- ii) 2 つのスイッチを閉じると、short-stub の電気長は $\theta_1$  (サセプタンス  $B_2$ ) となり、図 2・5 に示すように、入力信号と $-\pi/2 + \Delta \phi/2$  だけ位相が遅れた信号が出力ポートに搬出され

る.

このようにして,スイッチを閉じることによってスイッチが開いているときの信号に比べて +*Δač*け位相が進んだ信号を形成することができる.

表2・2は3種類のローディッドライン移相器の各パラメータの一例を示したものである. ロ ーディッドライン移相器は実装面積が小さく低損失であるという利点の一方で,大きな移相差 を得ようとするとバンド幅が狭くなるという欠点があり,また180°の移相器に至っては B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>がともに0となるために実現できないという問題がある.

$Z_0$ [ $\Omega$ ]	50							
$Z_c$ [ $\Omega$ ]	49.04							
$Z_{ss}$ [ $\Omega$ ]	50	55	60	65	70	75	80	
$\theta_1$ [deg]	78.75	77.66	76.58	75.50	74.44	73.39	72.35	
$\theta_2$ [deg]	22.50	24.68	26.85	29.00	31.12	33.23	35.31	
45°移相器								
$Z_0$ [ $\Omega$ ]	50							
$Z_c$ [ $\Omega$ ]	46.19							
$Z_{ss}$ [ $\Omega$ ]	50	55	60	65	70	75	80	
$\theta_1$ [deg]	67.50	65.50	63.57	61.70	59.89	58.15	56.47	
$\theta_2$ [deg]	45.00	48.99	52.86	56.60	60.22	63.71	67.07	
90 <sup>°</sup> 移相器								
$Z_0$ [ $\Omega$ ]	50							
$Z_c$ [ $\Omega$ ]	35.36							
$Z_{ss}$ [ $\Omega$ ]	50	55	60	65	70	75	80	
$\theta_1$ [deg]	45.00	42.27	39.81	37.57	35.54	33.69	32.01	
$\theta_2$ [deg]	90.00	95.45	100.4	104.9	108.9	112.6	116.0	

表2・2 ローディッドライン移相器の各パラメータの一例

### 8-2-2 ハイブリッド 2.5 GHz 移相器

図 2・7 は、4 ビット移相器とこの移相器を搭載したフェイズドアレイアンテナの模式図を示 したものである.移相器は、2 種類のローディッドライン移相器(22.5°と45°)及びスイッ チドライン移相器(90°と180°)から構成されている.また、移相器途中の伝送線路を折り 返して全体の寸法を小型にしている.移相器の一方の端にはアンテナが接続されており、各々 のアンテナ素子ごとに位相制御した RF 信号をアンテナに入出力することができる.

MEMS スイッチを利用した移相器の特性を評価するために,図 2・8 に示す 2.5 GHz で動作 する 90°スイッチドライン移相器を設計して試作した<sup>4)</sup>. この移相器の中央(2つのラインに 分岐した領域)の寸法は,20×30 mm であり,製作を容易にするために FR-4 プリント基板回



図2・7 4ビット移相器と移相器を搭載したフェイズドアレイアンテナの模式図



図2・8 90° スイッチドライン移相器 (2.5 GHz)

路と3個の MEMS スイッチ素子を別々に作製し、スイッチを基板回路に接着するというハイ ブリッド構成とした. MEMS スイッチは、移相器の分岐部分から $\lambda_g/4$ の距離に配置し、図2・ 9(a)に示すようにワイヤボンディングにより回路基板と電気的に接続するようにした. 移相器 は長さが $\lambda/4$ だけ異なる2本の伝送線から構成されており、短い伝送線を信号が通過するとき が Reference 状態、長い伝送線を信号が通過するときを Delay 状態と呼ぶ. Reference 状態と Delay 状態は、スイッチ素子によって切り替えられ、互いに90度の位相差(寸法差  $\lambda/4$ )を持 つ信号が通過する. 今回、図 2・9(b)に示すシャント抵抗型の MEMS スイッチを利用して移相 器を構成した. この MEMS スイッチは、コプレーナ線路(CPW)の上に並列に配置されてお り、プルダウンしたとき CPW の信号線と接地電極を短い距離(27  $\mu$ m)で短絡するように設 計されている. このため、高い周波数においても十分に大きなアイソレーションでスイッチ OFF することができる(なお、スイッチ ON 状態において、スイッチと伝送線路との間に形成 されるキャパシタンスは2fF 程度と十分に小さい. このため、高い周波数においても挿入損失 は十分に小さい(7 章参照)).



<sup>(</sup>a) ワイヤボンディングの模式図

(b) シャント型 MEMS スイッチ

図2・9 ハイブリッド接続した MEMS スイッチ

ハイブリッド移相器の移相量のシミュレーションと測定結果を図2・10に示す.この図より、 2.5 GHz 付近の移相量の大きさが式(2·1)に示すように周波数に比例して増大することが分か る. 試作した移相器は 2.5 GHz においてほぼ設計通りの 91.8°の移相量を持っていた.



図2・10 ハイブリッド移相器の移相量

### 8-2-3 挿入損失の要因

ハイブリッド移相器の透過係数 Sn のシミュレーションと測定の結果を図 2·11 に示す 5.3 GHz 以下の範囲で実測値とシミュレーション値が互いによく一致していることが分かる. 2.5 GHz での挿入損失の実測値は Reference 状態で 1.6 dB, Delay 状態で 1.8 dB であり, ハイブリ ッド構造であることを考慮すると低損失と考えられる.



図2・11 ハイブリッド移相器の透過係数 S21

図 2・12 は、挿入損失の要因を示したものである. 材料による損失(主に伝送線の誘電体損 失と MEMS スイッチの導体損失)のほかに、スタブ回路の損失(伝送線の誘電体損失と MEMS スイッチの挿入損失)とワイヤボンディングによるインピーダンスマッチングのずれなどが影 響して挿入損失が増大する. 特に、①MEMS スイッチ単体の挿入損失(実測値:0.3 dB),②線 路長 45.5~62 mm のマイクロストリップ線路の損失(0.5~0.6 dB),③MEMS スイッチと回路 を接続しているボンディングワイヤ、の影響が大きく、測定値とシミュレーションから表 2・3 に示す値が得られた.表 2・3 に示すように、上欄 4 個の損失の和と測定値がよく一致している ことが分かる. MEMS スイッチの損失が 0.3 dB と予期に反してかなり大きいが、これはスイ ッチ下部の伝送線幅を細く(幅 14 µm、厚さ 0.6 µm)設計したために配線抵抗による損失が増 大したためである. この設計によって約 0.25 dB の損失が信号線の抵抗によって発生したと見 積もられる. この損失は,MEMS スイッチの配線設計を見直すことにより改善することができ る.また、マイクロストリップ線路の損失は誘電体損失(表 2・1 の誘電正接)が主であること から、基板材料を見直すことによって改善できると考えられる.



図2・12 ハイブリッド移相器の挿入損失の要因

	Reference state	Delay state	Remarks	
1) Micro Strip Line	0.46	0.62	Measured	
2) Stub	0.48	0.48	Simulated	
3) MEMS Switch	0.34	0.68	Measured	
4) Bonding Wire	0.31	0.01	Measured from S11 data	
Total [(1)+(2)+(3)+(4)]	1.71	1.93	Calculated	
Total	1.63	1.81	Measured	

表2・3 ハイブリッド移相器の挿入損失

### 8-2-4 24 GHz モノリシック移相器

周波数が高くなるとアルミワイヤのインダクタンスの影響が深刻になるために, MEMS スイ ッチを集積化したモノリシック移相器が開発された.モノリシック移相器は, Grounded-Coplanar Wave (GCPW) 導波路とシャント型 MEMS スイッチから構成される.図 2・13(a)は, GCPW を利用した 180°移相器を示したものである<sup>の</sup>.GCPW は,高抵抗シリコン基板に Via を設けて裏面の GND と接続している.この移相器では図 2・13(b)に示す MEMS スイッチが 3 個形成されている.



(a) GCPW を利用した 180°移相器



移相器 (b) MEMS スイッチ 図 2・13 モノリシック移相器

Loaded-line 移相器はサセプタンスの異なる素子を切り替えることにより,移相量を得る方式 であり,小型で低損失,広帯域という特徴を持つ.しかし,大きな移相量には向かないことか ら,22.5°と45°の移相器に適している.Switched-line 移相器は,線路長の異なる伝送線路を 切り替えることによって移相量を得る方式であり,寸法が大きくなるものの,容易に大きな移 相量を得ることができるという特徴がある.このため,90°と180°の移相器として利用する ことができる.図2.14にこれら2種類の移相器の回路構成を示す.実際の設計では,MEMS スイッチによって発生する寄生キャパシタンスや寄生インダクタンスが伝送特性や移相特性 に与える影響を考慮して,移相器のパターンを若干修正することが必要となる.





45°の Loaded-line 移相器の伝送特性と移相量のシミュレーション結果を図 2・15 に示す. 24 GHz における Reference (図 2・14(a)のスイッチはシャント状態), Delay (図 2・14(a)のスイッチ はスルー状態)のそれぞれの挿入損失が共に 0.56 dB 以下と低損失であること, また, 24 GHz における移相量は 45.1°と所望の値に非常に近いことが分かる.

図 2・16 は、45° ローディッドライン移相器の移相量の測定結果を示したものである.図2・15(b)のシミュレーションとよく似た特性を示しており、24 GHz の位相差は-47.8°と所望の位相差に近い値を持っている.



図2・16 45° ローディッドライン移相器の移相量(測定値)



180°の Switched-line 移相器の伝送特性と移相量のシミュレーション結果を図 2・17 に示す. これより, Reference, Delay 共に 24 GHz における挿入損失が 1.10 dB 以下と低損失であること, また, 24 GHz における移相量は 179.3°と,所望の値に非常に近いことが分かる. 図 2・18 は 図 2・13 に示した 180°移相器の移相量の測定結果を示したものであり, 24 GHz の移相量が 184.2°と目標値に近いことが分かる. Switched-line 移相器は線路長の差によって位相を変化さ せることができることから, 4.2°程度の位相差は線路長を変更することにより容易に補正する ことができる.



図2・18 180° スイッチドライン移相器の移相量(測定値)

上に述べた 4 個の移相器を組み合わせて 4 bit 移相器を設計した.フェイズドアレイアンテ ナのアンテナ素子間隔を $\lambda_0/2$  ( $\lambda_0$ :真空中の波長)にするためには,4 ビット移相器を 1 辺が  $\lambda_0/2$ の正方形内に収めることが必要である.24 GHzの場合,(1 波長は 12.5 mm であるので) 6.25 mm 角の正方形内に 4 bit 移相器の寸法を収めることが要求される.GND 部を共有した 4 ビットモノリシック移相器を図 2・19 に示す.この 4 bit 移相器は 6133×6189  $\mu$ m の寸法を持っ ている.



図 2・19 4 ビットモノリシック移相 器のレイアウト図面



図 2・20 20~30 GHz における 4 bit 移 相器の 16 通りの移相量(シミュレー ション)

4 bit 移相器の各々のスイッチを操作して移相量を変化させることができる.スイッチの 16 通りの異なる状態に対して高周波シミュレーションを行った結果,24 GHz における挿入損失 が 3.34~4.41 dB (反射損失 7.41~25.0 dB) であることが分かった.20~30 GHz における 4 bit 移相器の 16 通りの移相量の計算結果を図 2・20 に示す.この図では Reference 状態に対する位 相差を示している.各移相状態ともに所望の移相差に近い値を示しており,設計に対する位相 誤差は -0.86~4.73°の範囲にある.この位相差は伝送線路の長さを調節することによって補 償することが可能である.

### ■10 群-8 編-8章

## 8-3 アンテナ

(執筆者:鈴木健一郎) [2018年10月受領]

ミリ波は GHz 帯の電磁波に比べて空中での減衰が大きい.このため、遠くまで伝搬するの に狭い角度にエネルギーを集中させた電磁波ビームを利用するが、ミリ波ビームを広い角度の 空間領域に放射するには電磁波ビームを走査することが必須となる.車載などの比較的大きな 装置では機械式ビーム走査を利用することができるが、ビーム走査速度が遅いという欠点があ る(このため、現在の車載用ミリ波レーダがカバーできる角度領域(<±5°)が狭く限られて いる).更に、携帯無線などの移動体無線では、小型軽量化の要求が新たに追加される.

以上の課題を解決するために、ビームを電気的に走査する方式が注目されている.このビー ム電子式走査方式(フェイズドアレイ:PAA)は、電磁波の干渉を利用してビームの放射方向 を変化させるものであり、位相差を生成する移相器が中心の役割を担っている.また、MEMS 技術を利用すると小さな機械で電磁波ビームを高速に走査することが可能である.以下に、 MEMS スイッチを使用した PAA と MEMS アクチュエータを使用した機械振動式アンテナを紹 介する.

### 8-3-1 アンテナの原理

電流によって生じた電磁界の変化は電磁波として空間を伝播する(第6章補遺参照).電磁 波を遠方まで伝搬させるには、アンテナを流れる電流を大きくとること、あるいは、電磁波ビ ームを狭く絞ることが必要である.アンテナを流れる電流は、アンテナの構造によって振動モ ードが決まり、アンテナの共振周波数のときにアンテナを流れる電流が最大となる.本節では、 アンテナを流れる電流によって生じる電磁波を考えてアンテナの電磁波放射の仕組みを述べ る.



図3・1 z軸に沿って置かれた電気双極子から放射される電磁波

図 3・1 に示すように、z軸に沿って置かれた電気双極子p (=  $P_0 e^{j\omega t}$ ) を考える. この電気 双極子は角振動数  $\omega$  で振動しているとする. このとき、電気双極子から距離 r にある空間に、以下の電場と磁場が発生する  $\eta$ .

$$E_r = \frac{p\cos\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^2} \left(\frac{1}{r} + jk\right) e^{-jkr}$$
(3 · 1a)

$$E_{\theta} = \frac{p \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{jk}{r} - k^2\right) e^{-jkr}$$
(3 · 1b)

$$H_{\phi} = \frac{j\omega p \sin\theta}{4\pi} \left(\frac{1}{r^2} + j\frac{k}{r}\right) e^{-jkr}$$
(3 · 1c)

ただし,

$$\frac{dp}{dt} = j\omega p \tag{3.1d}$$

である.ここで、kは波数である.式(3·1a)と式(3·1b)の中の距離rの3乗,2乗,1乗に逆比例する項は、それぞれ双極子の静的な場、遷移場、及び輻射場と呼ばれる.また、式(3·1c)の中の距離rの2乗と1乗に逆比例する項は、誘導場と輻射場と呼ばれる.アンテナで重要となるのは輻射場である.式(3·1)の中で輻射場(放射界とも呼ばれる)を取り出すと、

$$E_{\theta} = -\frac{pk^2 \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r} e^{-jkr} \tag{3.2a}$$

$$H_{\phi} = -\frac{\omega p k s i n \theta}{4\pi r} e^{-jkr} \tag{3.2b}$$

となる. 輻射場は,  $r \gg 1/k = \lambda/(2\pi)$ , すなわち, 1/6 波長以上の距離にある空間に生じる電磁 波の主な成分である.

アンテナが発生する輻射場は式(3・2)に示すようにアンテナに流れる電流(式(3・1d)参照) に依存する.一方,アンテナに流れる電流は,境界条件(生成される輻射場を含む)に依存す るため,一般に厳密に輻射場を求めることができない.しかし,アンテナに流れる電流が比較 的良い近似で得られるときには輻射場の解析解を良い近似で求めることができる.アンテナを 流れる電流はモーメント法と呼ばれる方法を使ったシミュレーションソフトで求めることが できる.また,アンテナが作る電磁界を直接に求める電磁界シミュレーションもよく利用され る.

### (1) 半波長ダイポールアンテナ

z軸に沿って置かれた長さ*l*を持つ1本の導体線アンテナを考える<sup>8)</sup>. この導体線の $z = \zeta の$ 位置に長さ $\Delta \zeta$ の微小双極子をとり、ここに電流 *l*( $\zeta$ ) が流れているとする. このとき、双極子 から (*r*,  $\theta$ )の位置にある磁場は、 $j\omega p = l(\zeta)\Delta \zeta$ を式(3·2b)に代入して、

$$\Delta H_{\varphi} = \frac{jkI(\zeta)\Delta\zeta \sin\theta}{4\pi(r-\zeta\cos\theta)} e^{-jk(r-\zeta\cos\theta)} \approx \frac{jkI(\zeta)\Delta\zeta \sin\theta}{4\pi r} e^{-jk(r-\zeta\cos\theta)}$$
(3 · 3)

と与えられる.指数関数の項はくの変化により急速に振動するためにくの項を除くことはでき ない.これより,導体線全体から生じる磁場は

$$H_{\phi} \approx \frac{jke^{-jkr}sin\theta}{4\pi r} \int_{-l/2}^{l/2} I(\zeta) e^{jk\zeta \cos\theta} d\zeta \tag{3.4}$$

で与えられる.

 $\lambda/2$ のアンテナ長  $l(k = \pi l)$ を持つ導体線の中央に交流電圧 Vを繋いだとき、アンテナを流れる電流は

$$I(\xi) = I_0 \cos k\xi, \ -l/2 \le \xi \le l/2$$
 (3.5)

の条件が成り立つときに最大に近くなる(この電流は定在波である). このとき, アンテナから 放射される電磁波の角周波数は

$$\omega = \pi c/l$$

 $(3 \cdot 6)$ 

となり,アンテナの共振周波数はアンテナ長に逆比例する.式(3・6)の c は真空中の光の速さ を示している.式(3・5)を式(3・4)に代入して計算すると,

$$H_{\phi} \approx \frac{jI_0 e^{-jkr} \cos(\frac{1}{2}\pi cos\theta)}{2\pi r} \frac{(3\cdot7)}{\sin\theta}$$

が得られる. また, 電場 E<sub>a</sub> は

$$E_{\theta} = \eta H_{\phi}, \qquad \eta = \frac{1}{R_0} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \tag{3.8}$$

の関係から式(3・7)を使って求めることができる.式(3・8)の R<sub>0</sub>は第6章演習問題[6.9]で示した電波インピーダンスである.式(3・5)の I<sub>0</sub>は以下の(3)節で述べるアンテナの等価回路を用いて給電電圧 V から近似的に求めることができる(モーメント法を用いたシミュレーションを用いるとこの電流を更に正確に求めることができる).

アンテナが放射する輻射場が式(3・7)と式(3・8)に示すように求まったので、次にアンテナが 放射する電力を求めよう.アンテナが放射する全電力は半径rの球面を通過するポインティン グベクトル(第6章式(6・A・12))を計算することによって

$$P = \int E_{\theta} H_{\phi}^* dS = \frac{\eta l_0 l_0^*}{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{\cos^2 \left(\frac{1}{2}\pi\cos\theta\right)}{\sin\theta} d\theta = \frac{\eta l_0 l_0^*}{4\pi} \text{Ci } 2\pi, \qquad \text{Ci } x = -\int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t} dt \quad (3 \cdot 9)$$

と表される. ここで  $H^*_{\phi}$ は  $H_{\phi}$ の複素共役である. また、Cixは積分余弦関数である. この放 射電力は、導体線の抵抗が小さいときには、アンテナに供給される電力  $R_{rad}I_0I^*_0$  に等しい.  $R_{rad}$ は放射抵抗と呼ばれ、式(3・9)より、

$$R_{\rm rad} = \frac{\eta}{4\pi} {\rm Ci} \ 2\pi = 2.438 \frac{\eta}{4\pi} \tag{3.10}$$

で与えられる.半波長ダイポールアンテナでは,  $R_{rad} = 73.08 \Omega$ である.一般に大きな放射抵抗を持つアンテナは電磁波を効率良く放射できることを意味する(実際には,アンテナを流れる電流がアンテナのリアクタンスに依存するために,放射電力も放射抵抗のほかにリアクタンスに依存する).

アンテナ長 *I が λ*/2 と異なるとき (アンテナの周波数が変化したとき)には,放射抵抗はアン テナ長に依存して変化する.モーメント法を用いた計算から *I が λ*/2 付近においてアンテナ長 が長くなるに従って放射抵抗が増大することが示される<sup>8</sup> (アンテナの放射電力は,下記(3)項 で述べるように給電系のインピーダンスを含めて考慮する必要がある).

アンテナから放射される電磁波は通常,ある特性の方向に強く放射される.この電磁波の強 度の偏りの程度を示すためにアンテナ利得が使われる.アンテナ利得は,最大の放射強度を持 つ方向への放射電力とアンテナに供給された電力を全方向に均一に放射したときの放射電力 との比として定義される.ダイポールアンテナの場合には,アンテナ利得は

$$G = \frac{E_{\theta}H^{*}_{\phi}}{R_{\rm rad}I^{1*}/(4\pi r^{2})} = \frac{4\pi r^{2}\eta H_{\phi}H^{*}_{\phi}}{R_{\rm rad}I^{1*}}$$
(3 · 11)

r

で与えられる.半波長ダイポールアンテナの利得は,式(3・7)で $\theta = \pi/2$ と置いたときの $H_{\phi}$ と式 (3・10)を用いて,2.15 dB と求められる.

### (2) パッチアンテナ

先に述べたダイポールアンテナは導体を空間に置いたものであった.これに対して,パッチ アンテナは導体パターン(パッチ)を誘電体基板の上に置いた構造をしている. 図 3・2(a)に示 すように,厚さ d を持つ誘電体基板の上に導体パターン(長さ 2a,幅 2w)を形成し,誘電体 基板裏面の全面にグランドに接続した導体(地板)から構成される.同図に示すように,x軸 方向に電流 I が流れるとき,このパッチ表面から放射する電磁波は地板に流れる電流(-x軸 方向を持つ -I)から放射する電磁波によって打ち消される(マイクロストリップ線路から放 射する電磁波はゼロである).一方,パッチの端面には地板との間に同図の矢印で示す電界が 発生する.この電界が周りの空間に電磁波を作る源となる.誘電体基板の厚さ d は電磁波の波 長に比べて小さいために,パッチの端面に形成される電界は図 3・2(b)に示すように幅 d を持つ スロットが設けられた導体パターンとして近似することができる.ここで,パッチの上下端面 に形成される 2 つの電界は、同じ方向を持っている.この結果、この電界が発生するが、同図 に見るように互いに反対の方向を持っているため、これら電界によって作られる電磁波は互い に打ち消し合う.



(a) パッチアンテナ
 (b) パッチアンテナのスロットモデル
 図3・2 方形パッチアンテナ

図 3・2 に示す方形パッチアンテナの遠方での電界は

$$E_{\theta} \approx -\frac{jV_0 e^{-jkr} \sin(kw \sin\theta \sin\phi) \cos(ka \sin\theta \cos\phi)}{\pi r} \cos\phi \qquad (3 \cdot 12a)$$

$$E_{\phi} \approx \frac{j v_0 e^{-jkr} \sin(kw \, \sin\theta \, \sin\phi) \, \cos(ka \, \sin\theta \, \cos\phi)}{\pi r} \cos\theta \qquad (3 \cdot 12b)$$

と表される<sup>9</sup>. ここで、 $V_0$ は $x = \pm a$ のパッチ上下端部と地板との間に発生する電圧である. また、式(3・12)では、パッチ側面の端 (y 軸方向の端面)から放射される電界を省略した.

導体の長さ 2*a* は  $\lambda_{g}$ /2 に等しいときに導体を流れる電流が最大となる ( $\lambda_{g}$  は式(2・1)に示す 伝搬波長)のは,先のダイポールアンテナ (導線の長さは  $\lambda_{g}$ /2 に等しい)と同じである.導体 の幅 2*w* は大きいほど電磁波の源の強度が増えるので放射が大きくなるが, 2*a* よりも大きくす ると, 導体を流れる電流の方向が x 軸から変化するので, 通常 2w=2a となるように形成する. 図  $3\cdot 2$  の黒丸は給電ポイントを示している.これは, x=0 (導体の中央)の位置では電圧がゼロ, また,  $x=\pm a$  (パッチの上下端)の位置では電流がゼロ, となるためにアンテナに給電ができないからである.

### (3) インピーダンスマッチング

アンテナの等価回路を図 **3・3** に示す. ここで示す回路パラメータはアンテナと給電系とをつないだ位置(図の丸印)で測られるものである. アンテナの導体線の抵抗を $r_a$ とするとき,アンテナの入力インピーダンスは ( $r_a + R_{rad}$ ) + jXであり,このアンテナに電圧電源 Vと特性抵抗(特性インピーダンスの抵抗成分)  $r_c$ を持つ伝送線路を接続する.



図3・3 アンテナの電気等価回路モデル

アンテナの入力端の電流は、図3・3の等価回路から、

$$I(0) = \frac{V}{r_c + r_a + R_{\rm rad} + jX} \tag{3.13}$$

と表される.ここで、I(0)は図 3·3 の丸印の位置を流れる電流である.

アンテナの放射電力 Pは抵抗 Rrad で消費する電力として

$$P = R_{\rm rad} I(0) I^*(0) \tag{3.14}$$

と求められる.式(3・13)を式(3・14)に代入すると、アンテナの放射電力が

$$P = \frac{R_{\rm rad}|V|^2}{(r_c + r_a + R_{\rm rad})^2 + X^2}$$
(3 · 15)

と求められる. R<sub>rad</sub>を変化させたとき,式(3·15)のPが最大となるのは,

$$R_{\rm rad} = r_c + r_a \qquad X = 0 \tag{3.16}$$

のときであり、このとき、最大放射電力は

$$P_{\max} = \frac{(r_c + r_a)|v|^2}{4r_c^2} \approx \frac{|v|^2}{4r_c}$$
(3 · 17)

で与えられる.最後の式は*r<sub>a</sub><< r<sub>c</sub>が成り立つときである.式(3・16)の条件が満足されるとき, アンテナと給電する伝送線路がマッチングしているという.* 

半波長ダイポールアンテナのリアクタンス X がゼロとなるのはアンテナの長さがλ/2 よりも 少し短い(約0.49λ)ときである<sup>8)</sup>. 半波長ダイポールアンテナは式(3·15)に示すように放射 電力が(周波数に依存する)リアクタンス X に依存するために放射電力が周波数に依存して変 化する.このため、放射電力が最大となる*X*がゼロとなる周波数帯が限られるため、アンテナの周波数特性が狭いという欠点を持っている.

アンテナに電流が流れるとき, $r_a$ と $R_{rad}$ の2つの抵抗で電力が消費される. $R_{rad}/(r_a + R_{rad})$ はアンテナ全入力電力と放射電力との比を示しており、アンテナの効率を表している.

### 8-3-2 アレイアンテナの指向性

半波長ダイポールアンテナの電界と磁界は式(3・8)と式(3・7)に示すようにθに依存して変化 する.アンテナから放射される電界と磁界の強さの相対値を球面座標の方位(θ, φ)に対して示 したものをアンテナの指向性と呼ぶ.半波長ダイポールアンテナでは,指向性は式(3・7)から,

$$D(\theta) = \frac{\cos(\frac{1}{2}\pi\cos\theta)}{\sin\theta}$$
(3.18)

と表される. 電界と磁界が共に等しい指向性を持つ.  $\phi$ が一定の面( $E_{\theta}$ の方向)で指向性を極座標( $D(\theta), \theta$ )で描くと8の字の形をしたグラフとなる. 一方,  $\theta$ が一定の面( $H_{\varphi}$ の方向)で指向性を極座標( $D(\theta), \phi$ )で描くと円形のグラフとなる.

式(3·18)で示される指向性のグラフは、θ=π/2のときに最大値1をとる.このことから、半 波長ダイポールアンテナではアンテナに垂直な方向に強い電磁波が放射されることが分かる. 半波長ダイポールアンテナは指向性を持つために、式(3·11)に示すようにアンテナ利得 2.15 dB を持つビームをアンテナに垂直な方向に放射する.しかし、この指向性はアンテナが動かない 限り変化しないので、ビームを走査することが必要である.



図3・4 1次元に配列されたアンテナアレイ

アンテナの指向性を変化させるために、アンテナを多数並べたアンテナアレイを考える.アレイアンテナの指向性が素子の構成及び給電の位相に依存する関係を図3・4に示す1次元アレイアンテナを用いて導出する.ここで、波数 k,アレイ間隔 d,給電の位相差  $\Delta \phi$  とし、アンテナ素子数を n とする.アンテナから観測点までの距離 r<sub>0</sub>で角度 $\theta$ 方向に放射される電磁波の電界成分を  $P(\theta)$ とすると、 $\theta=0$ の方向に最大の強さを持つ電磁波が放射される.  $P_0 = P(0)$ とすると、アレイアンテナの指向性関数は、

$$D(\theta) = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$$
  
= 20 \log\_{10} \left[ \frac{1}{n} \left\{ 2 \sum\_{i=1}^{(n-1)/2} \cos(k \vert i d \sin \theta - \vert i \Delta \phi) + 1 \right\} \right] (3 \cdot 19)

と表される<sup>10</sup>. 図3·5 は式(3·19)の指向性関数を模式的に示したものである. アレイアンテナ の指向性パターンは複数のビームから形成されるが,最も出力の大きなビームがメインビーム である.メインビームの鋭さはビームの電力が半分(-3 dB)になる電力半値幅によって評価 される(式(3·19)では-6 dBである).メインビームの周りに存在する小さなビームはサイド ローブと呼ばれ,外来ノイズの原因となるためアンテナには不要である.その他に,アンテナ 素子の配置や位相の状態によっては,図3·5 右上に示すようにメインビームと同じ大きさのグ レーティングローブと呼ばれるビームが発生することがある.



次に、アンテナ素子の位相差  $\Delta \phi$ を変化させた場合のビームの変化を図 **3**・6 に示す. 図 **3**・6(a)は  $\Delta \phi < 0$  の場合である.また、図 **3**・6(c)は  $\Delta \phi > 0$  の場合である.このように、位相差  $\Delta \phi$  を変化させることによってメインビームの方向を変化させることができる.フェイズドアレイアンテナ(PAA)はこのように位相差  $\Delta \phi$ を電気的に制御することによってメインビームの放射方向を操ることができるアンテナであり、機械でアンテナを走査することに比べて、走査速度が速いという特徴がある.



(a)  $\Delta \phi < 0$ 

(b)  $\Delta \phi = 0$ 

(c)  $\Delta \phi > 0$ 

#### 図3・6 アレイアンテナの指向性のAØ依存性

### 8-3-3 積層構造 MEMS アレイアンテナ

MEMS 移相器を利用したフェイズドアレイアンテナの模式図を図 3・7 に示す<sup>5</sup>. 1×4 アレ イアンテナの構成を例にして説明する.入力 RF 信号は,2 段の2 分配ウィルキンソン分配器 (Power Divider)により等分に4 分割され,それぞれが4 bit 移相器 (Phase Shifter)に送られ る. その後,各々の移相器で設定の値だけ遅延した位相を持つ高周波信号が個々のアンテナに 給電されて,最後に,指向性を持つビームが空間に放射される.1枚の基板の上にフェイズド アレイアンテナのすべての構成要素を作製すると分配器や移相器が基板面積の多くを占めて しまうために,アンテナの間隔を短くすることができないという問題が生じる.このため,図 3・7に示すように多層構造を用いるとアンテナを小型化することができる.また,多層構造ア ンテナは,アンテナを2次元に並べることによってメインビームを2次元的に走査することを 可能にする.



図3・7 MEMS 移相器を利用したフェイズドアレイアンテナの模式図

多層構造フェイズドアレイアンテナの実現には,移相器寸法をアンテナ素子間隔以内に収めること,上下基板間の信号伝達方法,MEMSスイッチの密封,などの諸課題を解決しなければいけない.

#### (1) アンテナの構成要素

FR-4 基板を用いて試作した 2.5 GHz 信号用のウィルキンソン分配器の写真と通過特性の測定値を図 3・8 に示す. 試作した分配器は,厚さ 0.8 mmのガラスエポキシ(FR-4) プリント基板上に形成された厚さ 30  $\mu$ mの銅箔パターンを利用して,特性インピーダンス 70.7  $\Omega$ の 1/4 波長 ( $\lambda$ /4) 線路長を持つマイクロストリップラインと 100  $\Omega$ のチップ抵抗によって構成されている<sup>11)</sup>. これによって,各ポートの特性インピーダンスが 50  $\Omega$ となるように整合されている. 図 3・8(b)は試作した分配器の通過特性を測定したものである.  $S_{21}$ と $S_{31}$ がほぼ -6 dB と等しい値になっていることが分かる.また, $S_{32}$ が 2.5 GHz 付近で小さくなっており,アイソレーションがとれていることが分かる.

図 3・9(a)は、FR-4 基板の上に作製した方形パッチアンテナである.アンテナ寸法は伝達波長の1/2 となるように設計した.給電線は、アンテナとインピーダンス整合をとるために同図に示すようにアンテナ内部に接続した(共平面給電)<sup>12)</sup>.反射特性の測定値を図 3・9(b)に示す. ほぼ設計通りの 2.5 GHz にアンテナの共振を確認することができた.



図3・8 2.5 GHz 用のウィルキンソン分配器





図 3・10 は、4 個のアンテナ素子を持つアレイアンテナを FR-4 基板の上に試作したものである. 個々のアンテナ素子は真空の波長の 1/2 の間隔で配置されている. アレイアンテナの反射特性 ( $S_{11}$ )の測定値を単体のアンテナの反射特性と比較したものを図 3・11 に示す. この図から、単体とアレイアンテナについて、 $S_{11}$ が最小となる周波数 (アンテナの共振周波数) がほぼ等しいことが分かる.



図3・10 2.5 GHz 用の方形パッチアンテナ



図 3・11 アレイアンテナと単体のアンテ ナの反射特性の比較

図3・12 アレイアンテナの指向性(放射電力)

図 3・12 はアレイアンテナの指向性の測定値(同図には放射電力を示す)をシミュレーションの値と比較して示したものである.アンテナ指向性の半値幅として約25°が得られたが、これはシミュレーションの値と近いものである.

先に示したアンテナは FR-4 基板を使用して作製された 2.5 GHz の低い周波数で使用するものであった. このため,アンテナの寸法が大きかった.しかし,シリコン基板を使用すると,有効誘電率が約 2.4 倍となる (8-2 節表 2・1) ために,アンテナを 1/2.4 に小さくすることができる.また,30 GHz の準ミリ波を利用するときにはアンテナの素子間隔を 5 mm に小さくできるために,アンテナを小型にすることができる.

### (2) 電磁結合給電

先に図 3・9 と図 3・10 に示したアンテナは給電線と直接に接続する直結給電方式を利用して 試作したものであった.積層構造アンテナでは(直結給電方式のほかに)電磁結合を利用した 給電方式を利用することができる.図3・13 にスロット結合給電(Slot-coupled Microstrip Feed) を利用したアンテナ給電の模式図を示す.伝送線に電流が流れるとき,その裏面の GND 地板 に逆方向の電流が流れる.この地板の途中にスロットが設けられているときにはスロットの端 に地板の電流の流れる方向に沿った電界が発生する.この電界から電磁波が作られてアンテナ に伝搬する.伝送線の電流がアンテナの共振周波数を持つとき,アンテナから強い電磁波が放 射される.



図3・13 スロット結合給電の模式図



図 3・14(a)は 2 枚の FR-4 基板を使用して図 3・13 の構造を試作したものである. アンテナは 5 GHz で共振するように設計した. このアンテナの反射特性の測定値を図 3・14(b)に示す. 設計 通りの周波数でアンテナが共振したことが分かる. 5 GHz 付近の  $S_{11}$  が -9 dB とかなり大きい が,これはインピーダンス整合がうまくいっていないからである. 図 3・13 に示す伝送線のス ロットから飛び出した長さ (通常は  $\lambda_{g}/2$  とする)を調整することによってスロット結合のイン ピーダンス整合を調節することができる.

### 8-3-4 機械振動式 MEMS アンテナ

アレイアンテナは式(3・19)に示すようにアンテナ要素の数を増やすほど鋭い指向性を持つ. アレイアンテナが放射する電磁波ビームを機械振動を利用して走査すると,一般に機械が大型 で重いために電磁波ビームを高速に走査することができないという問題がある.以下に,この 問題を解決することができる MEMS 技術を利用した機械振動式アンテナを紹介する.



図 3・15 機械振動式 MEMS アンテナの模式図

図 3・15 は機械振動式 MEMS アンテナの構造を示したものである. 指向性を持つアンテナア レイが MEMS アクチュエータと一緒に形成されており, アクチュエータの回転運動に従って アンテナを円周の一部にそって往復運動させることができる.このアンテナは電磁結合給電に よって電力が給電されるため、外部と結線する必要がない.また、アンテナアレイは構造が簡 単で鋭い指向性を得ることが可能な八木・宇田アンテナを利用した.アンテナを駆動するアク チュエータは MEMS 技術を利用することによって小型で軽量にすることができるため、アン テナを含むアクチュエータ構造を1kHzの高速で動作させることができる.更に、アクチュエ ータの機械構造体の共振を利用することにより、大きな走査角度(±20°程度)を実現するこ とを可能にする.

図 3・16 は電磁結合給電を評価するために, FR-4 基板の上に作製した 2 つのダイポールアン テナを 1 mm 離した距離に置いて互いのアンテナを傾けたときの伝達電力を測定したものであ る. 同図より互いのアンテナを 20°傾けても電磁結合によって給電された電力がほとんど減 衰しないことが分かる.



図3・16 電磁結合給電の評価実験



スパイラルスプリング構造

図3・17 シリコン MEMS アクチュエータ

図 3・17 はシリコン基板を使って作製した MEMS アクチュエータである<sup>13)</sup>. MEMS アクチ ュエータは櫛歯電極に印加される静電気力によって駆動される. アクチュエータの共振周波数

 $(3 \cdot 20)$ 

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{\theta}}{m}}, \quad k_{\theta} = \frac{2nEI}{l^2}$$

で与えられる.ここで, m は質量,  $k_{\theta}$ はアクチュエータの回転ばねのばね定数である.また, *E*,*I*,*I*,*n* はそれぞれ回転ばねのヤング率,断面 2 次モーメント,長さ,ばねの数である.式(3・20)より,共振周波数を高くするには,質量 m を小さくすることとばねの長さ *I*を短くするこ とが有効であることが分かる(断面 2 次モーメント *I*を大きくすることも有効であるが,ばね の幅及び厚さを大きくすることは作製プロセスから制限される).質量 m は図 3・17 に示すよ うに機械構造体に穴を設けることによって小さくできるが,限界がある.このため,ばねの長 さ*I*を短くすることが共振周波数を大きくするのに最も有効である.他方,回転角度は

$$\Delta\theta = Q \frac{T}{k_{\theta}} \tag{3.21}$$

で与えられる.ここで、Tは静電気力によって発生した回転トルク、Qは共振のQ値である. 式(3・21)より、 $k_{\theta}$ を大きくすると回転角度が減少することが分かる.このように、高い共振波 数と大きな走査角度は互いにトレードオフする関係にある.MEMSアクチュエータでは10000 を超えるQ値を持つ構造体を比較的容易に作製することができるため、大きなQ値を利用し て回転角度を大きくすることができる.

試作したアクチュエータを 40 Pa の圧力に置き,20 V バイアスに 6.5 V の振幅を持つ交流を 重畳した電圧源で駆動したときのアクチュエータの回転角振幅の測定値を図 3・18 に示す.こ のデータより,試作したアクチュエータは共振周波数 918 Hz(シミュレーションでは共振波数 1081 Hz) で最大振幅 6.23°で回転動作することが分かる.圧力を低くすると(1 Pa 程度),も っと大きな O 値を得ることができる.



図3・18 シリコン MEMS アクチュエータの特性

は

### ■10 群-8 編-8章

## 8-4 まとめ

(執筆者:鈴木健一郎) [2018年10月受領]

情報通信の急速な進歩に伴って携帯用ワイヤレス通信がますます重要になってきた.今日, 携帯端末で使用する周波数とデータが増大することから,広い周波数帯(ブロードバンド)と 高周波化(高速データ通信)が強く望まれている.高周波化に対応するためには,機器のワイ ヤレス通信フロントエンド回路に周波数可変機能を搭載することが必要である.このとき,周 波数変化に追随してインピーダンス整合を自動的に調節することも要求される.これはリコン フィグラブルと呼ばれており,近年の高周波応用研究の一つの大きな目標である.

MEMS 技術を利用して周波数可変機能を持つアンテナは, MEMS スイッチを切り替えてア ンテナのインピーダンスを広範囲に変化させるものが積極的に開発されているが, 最近, 水の 搬送を利用してアンテナ寸法を変化させる研究<sup>14)</sup>もなされている.また, ミリ波レーダは車 載用としてすでに製品化されているが, これを利用した医療応用研究も積極的になされている.

周波数の高速化については、現在、ミリ波帯(60~70 GHz)が製品化されているところであ るが、100 GHz を超える高周波デバイスについても積極的に研究がなされている.更に、1 THz 付近のテラヘルツ領域が光学と高周波工学の境界領域として注目されている.今後、テラヘル ツデバイスについても MEMS 技術が利用されると期待される.

### ■10 群-8 編-8章

### 補遺 8-A 無損失 Loaded-line 移相器

(執筆者:鈴木健一郎)[2018年10月受領] 2 ポート回路の電圧-電流変換行列(ABCD行列)は以下のように表される<sup>15)</sup>.

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_m & B_m \\ C_m & D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$
(8 · A · 1)

ここで、電流  $I_1$ 及び  $I_2$ はこの 2 ポート回路に流入する向きが正になるように定義されている. ABCD 行列を使うと、カスケード接続した 2 ポートの ABCD 行列はカスケード接続する前の 2 つの ABCD 行列の積として求めることができる. 図 2・4 に示す回路のように、 $\theta$ の電気長を持 つ特性インピーダンス  $Z_c$ の伝送線路の両側にアドミタンス  $G_i + jB_i$  (i = 1, 2)を接続した回路 は、入力端子に  $B_1 \ge B_2$ を接続した領域、電気長 $\theta$ の領域、出力端子に  $B_1 \ge B_2$ を接続した領域 の 3 つの領域をカスケード接続したものと考えられる. この ABCD 行列は、

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G_i + jB_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & jZ_c \sin \theta \\ j \sin \theta / Z_c & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ G_i + jB_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$
(8 · A · 2a)

のようにそれぞれの領域の ABCD 行列の積として求められる.この結果,式(8·A·1)の ABCD 行列の成分が

$$\begin{aligned} A_{m,i} &= D_{m,i} = (\cos\theta - B_i Z_c \sin\theta) + j G_i Z_c \sin\theta \\ B_{m,i} &= j Z_c \sin\theta \\ C_{m,i} &= 2G_i (\cos\theta - B_i Z_c \sin\theta) + j Z_c \Big[ 2B_i Y_c \cos\theta + (Y_c^2 + G_i^2 - B_i^2) \sin\theta \Big] \end{aligned} \tag{8.A.2b}$$

として与えられる.S行列はABCD行列の成分から

$$S_{11,i} = \frac{B_{m,i}Y_0 - C_{m,i}Z_0}{2A_{m,i} + B_{m,i}Y_0 + C_{m,i}Z_0}$$

$$S_{21,i} = \frac{2}{2A_{m,i} + B_{m,i}Y_0 + C_{m,i}Z_0}$$
(8 · A · 3)

と求められる<sup>15)</sup>. ここで Loaded-line 回路によって反射が生じない(インピーダンス整合がな されている)と仮定すると, S<sub>11.1</sub>=0 であるため,以下の関係が得られる.

$$B_{m,i}Y_0 = C_{m,i}Z_0 \tag{8.A.4}$$

これを式(8·A·3)の第二式に代入すると

$$S_{21,i} = \frac{1}{A_{m,i} + B_{m,i}Y_0}$$
(8 · A · 5)

が得られる.この式の $A_{m,i}$ と $B_{m,i}$ に式(8·A·2b)を代入し、無損失( $G_i = 0$ )を仮定すると

$$S_{21j} = \frac{1}{(\cos\theta - B_{,}Z_{C}\sin\theta) + jY_{0}Z_{C}\sin\theta}$$
(8 · A · 6)

が得られる.いま、 $S_{11i} = 0$ を考えているので、 $S_{21i}$ の絶対値は1となる.このため、 $S_{21i}$ の位

## 相をøとおくと,式(8·A·6)は

$$\cos \phi_i = \cos \theta - B_i Z_c \sin \theta$$
  

$$\sin \phi_i = -Y_0 Z_c \sin \theta$$
(8 · A · 7)

となる.式(8・A・7)より, $S_{21}$ の位相 $\phi$ の sin  $\phi$ は一定の値をとるが, cos  $\phi$ は i=1,2の2つの状態で変化することに注目されたい.最後に $\phi$ を B<sub>1</sub>と B<sub>2</sub>に対応してそれぞれ ( $-\pi/2 - \Delta \phi/2$ )と ( $-\pi/2 + \Delta \phi/2$ ) と置き換えることにより,式(2・2)の関係が得られる.

### ■8 章演習問題

- [8.1] 30 GHzの周波数において、ある基板の上に形成された CPW の波長をするとき、図 2・2 に示す 90°スイッチドライン移相器の寸法を求め、図 2・6 に示すローディッドライン 移相器の寸法と比較せよ。
- [8.2] 伝送線路に並列にアドミタンス *G* + *jB* が接続された 2 ポート回路の ABCD 行列を求め よ.
- [8.3] 伝送線路にインピーダンス  $Z_c$ を持つ電気長 $\theta$ の線路が直列に接続された 2 ポート回路 の ABCD 行列を求めよ.
- [8.4] 上記(2·5)と(2·6)の結果を用いて図 2·4の回路の ABCD 行列を求めよ.
- [8.5] S<sub>11</sub>及び S<sub>21</sub>の定義と式(8·A·1)から式(8·A·3)を求めよ.
- [8.6] 式(2・4)を求めよ.
- [8.7] 式(3・3)より真空中の輻射場において下記の関係があることを示せ.

$$\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \vec{n} \times \vec{E}, \ \vec{n} = \frac{\vec{k}}{k}$$

これは6章演習問題[6.9]に示した関係である.

- [8.8] 式(3・1)を電磁気学の教科書(例えば文献 8))を使って導出せよ、物理の教科書では時間依存性をe<sup>-jωt</sup>として表すことが多いが、本章ではこの時間依存性を工学で用いられる e<sup>jωt</sup>としたので注意が必要である。
- [8.9] 式(3・7)を式(3・4)と式(3・5)から導け.
- [8.10] 式(3・10)を導け.
- [8.11] 式(3·11)を利用してダイポールアンテナの利得が 2.15 dB であることを導け.
- [8.12] 式(3·15)を R<sub>rad</sub>で微分することにより, P が最大となる条件として式(3·16)が得られる こと示せ.

#### ■参考文献

- G.M. Rebeiz : "RF MEMS Theory, Design, and Technology," John Willey & Sons, Inc., Hoboken, Chapter 10, 2003.
- 2) 内藤喜之: "マイクロ波・ミリ波工学," コロナ社, pp.40, 1986.
- H.A. Atwater : "Circuit Design of the Loaded-line Phase Shifter," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol.33, no.7, pp.626-634, 1985.
- Ado, T. Furutsuka, and K. Suzuki : "2.5 GHz Low Insertion Loss MEMS Hybrid Phase Shifters Using Micro-Electro-Mechanical Switches," Japanese Journal of Applied Physics, vol.49, pp.06GN18:1-5, 2010.
- K. Suzuki, H. Ado, K. Yagi, T. Furutsuka, and K. Suzuki : "Study on a Phased-Array Antenna with MEMS Switches," IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, vol.130, no.11, pp.537-542, 2010.
- T. Watanabe, R. Yamazaki, T. Furutsuka, S. Tanaka, and K. Suzuki : "A quasi-millimeter wave band phase shifter with MEMS shunt switches," Proc. of 2014 Asia-Pacific Microwave Conference, WE1E-3, 2014.
- 7) パノフスキー,フィリップス: "電磁気学,"吉岡書店, pp.292, 2002.
- 8) 後藤尚久: "図説・アンテナ," 電子情報通信学会, pp.153, 2000.
- 9) 後藤尚久: "図説・アンテナ," 電子情報通信学会, pp.202, 2000.
- 10) ファインマン,レイトン,サイズ: "ファインマン物理学 III 電磁気学," 岩波書店, 1969.
- E.J. Wilkinson : "An N-Way Hybrid Power Divider," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol.8, no.1, pp.116-118, 1960.
- 12) J. Howell : "Microstrip antennas," IEEE Trans. Antennas Propag., vol.23, no.1, pp.90-93, 1975.
- 13) Y. Motoki, R. Inoue, H. Tanigawa, T. Nishino, T. Furutsuka, and K. Suzuki : "Design on MEMS Actuator for

Driving Resonant Yagi-Uda Antenna," Proc. of the 7th Integrated MEMS Symp., Niigata, The Japan Society of Applied Physics, 29pm1-D-1, Oct. 29, 2015.

- 14) Y. Shitanaka, T. Furutsuka, and K. Suzuki : "Fundamental research on variable frequency fluid MEMS antenna," Proc. of the 9th Integrated MEMS Symp., Hiroshima, The Japan Society of Applied Physics, 01am2-PM-5, Oct. 31, 2017.
- P.R. Karmel, G.D. Colef, and R.L. Camisa : "Introduction to Electromagnetic and Microwave Engineering," John Wiley & Sons, Inc. New York, pp.571, 590, 1998.